



# DSC 200

## DESKTOP SPUTTER COATER

### 台式溅射仪

采用一线品牌无油干泵和分子泵组产生一个洁净的 $<10^{-3}$  Pa的真空压强，通常抽真空时间小于5-10分钟。

采用高品质恒功率磁控溅射电源，确保恒定镀膜沉积速率。磁控阴极的使用也有效减少等离子体对样品的热影响和离子轰击损伤。特别适用于溅射金属制备薄膜电极，以及高分辨率场发射FE-SEM 扫描电镜样品的喷金、铂等用途。触摸屏自动控制，即插即用。



双靶!

可配Plasma清洗源!

可加偏压!

特别适用薄膜电极!

即插即用!

触摸屏控制!

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

Shenzhen, China

[Http://www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
主要用途	金属薄膜电极 SEM喷金/喷Pt/Mo/Ti/Cr/C等 表面亲水化处理/等离子清洗(选配)
真空泵组	标配进口品牌无油干泵+分子泵组/选配进口品牌油泵
泵组抽速	>2 m <sup>3</sup> /h 无油干泵+85 L/S 分子泵
极限真空	<9*10E-4 Pa
工作气压	0.3-2 Pa
抽空时间	<5 Min (<9*10E-3 Pa)
真空测量	测量范围大气压到10E-5 Pa, 进口品牌复合真空计
气体控制	两路 MFC 气体质量流量控制器 (50 SCCM Ar/N <sub>2</sub> )
腔室尺寸	~Ø 260 *150 mm
磁控靶源	靶材尺寸 Ø 50 *0.1-5 mm (建议厚度>0.2 mm) /2只 可实现单靶溅射/双靶交替溅射/双靶共溅射 带独立挡板, 可溅射贵金属Au/Pt等, 或金属Al、Cr、Ag、Ti等金属(通Ar气)
溅射电源	恒功率磁控DC溅射电源 Max. 300W, Max. 500 mA 偏压DC溅射电源 0-300V/100mA 电源(选配)
溅射时间	可程序设定
样品台	样品原则上高度小于 25 mm 基片台旋转速度 2-20 RPM Ø 100 mm 沉积均匀性 +/- 5%
等离子清洗	可选配RF射频等离子清洗源 (50W)
操作方式	触摸屏控制
重量尺寸	~80 Kg / 580 mm宽*600 mm深*1100 mm高
输入电源	220V AC, 50/60Hz 接地三脚插头
输入功耗	< 1500 W
冷却方式	标配水冷机
质量保证	一年免费/终身维护
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司  
地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009  
电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205  
邮件: sales@suproinst.com  
Http://www.suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司(北京办事处)  
地址: 北京市海淀区太平路甲40号金玉元E座105室  
电话: 010-63839091 传真: 010-63839091  
邮件: zkchang@suproinst.com